

C

1、更正之訂正中文本說明書

更正之訂正內容		更正之訂正後 (無劃線本)(A1)
更正之訂正前(A)	更正之訂正後 (劃線部分)(A1)	
[0024]……該導管因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之接合而被密封。	[0024]……該導管 <u>流體通道</u> 因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之接合而被密封。	[0024]……該流體通道因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之接合而被密封。
說明	檢送書件：更正之訂正後中文本說明書之劃線本(A1)。	

2、更正之訂正中文本申請專利範圍

更正之訂正內容		更正之訂正後 (無劃線本)(A1)
更正之訂正前(A)	更正之訂正後 (劃線部分)(A1)	
1. ° 2. ° 3. 第二層亦可由若干其他防水及非抗紫外線物質製成，例如二氧化鉻(CrO ₂)、矽烷、矽氧烷、含氟聚合物如聚四氟乙烯 AF 等。	1. ° 2. ° 3. 第二層亦可由若干其他防水及非抗紫外線物質製成，例如二氧化鉻(CrO ₂)、矽烷、矽氧烷、含氟聚合物如聚 <u>四氟乙烯 AF 鐵氟龍 AF</u> 等。	1. ° 2. ° 3. 第二層亦可由若干其他防水及非抗紫外線物質製成，例如二氧化鉻(CrO ₂)、矽烷、矽氧烷、含氟聚合物如鐵氟龍 AF 等。
4. ° 至 12. °	4. ° 至 12. °	4. ° 至 12. °
說明	檢送書件：更正之訂正後中文本申請專利範圍之劃線本(A1)。	

3、更正之訂正公告本說明書

更正之訂正內容		更正之訂正後 (無劃線本)(B1)
更正之訂正前(B)	更正之訂正後 (劃線部分)(B1)	
[0024]……該導管因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之接合而被密封。	[0024]……該導管 <u>流體通道</u> 因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之接合而被密封。	[0024]……該流體通道因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之接合而被密封。
說明	檢送書件：更正之訂正後公告本說明書之更正內容(劃線本)(B1)-申請書已記載更正內容，得不檢送。	

4、更正之訂正公告本申請專利範圍

更正之訂正內容		更正之訂正後 (無劃線本)(B1)
更正之訂正前(B)	更正之訂正後 (劃線部分)(B1)	
1. ° 2. ° 3. 第二層亦可由若干其他防水及非抗紫外線物質製成，例如二氧化鉻(CrO ₂)、矽氧烷、含氟聚合物如聚四氟乙烯 AF 等。 4. ° 至 12. °	1. ° 2. ° 3. 第二層亦可由若干其他防水及非抗紫外線物質製成，例如二氧化鉻(CrO ₂)、矽氧烷、含氟聚合物如聚 <u>四</u> 氟 <u>乙</u> 烯 <u>AF</u> <u>鐵</u> 氟龍 AF 等。 4. ° 至 12. °	1. ° 2. ° 3. 第二層亦可由若干其他防水及非抗紫外線物質製成，例如二氧化鉻(CrO ₂)、矽氧烷、含氟聚合物如鐵氟龍 AF 等。 4. ° 至 12. °
說明	檢送書件：更正之訂正後公告本申請專利範圍之更正內容(劃線本)(B1)-申請書已記載更正內容，得不檢送。	

5、其他事由之更正說明書

更正內容		更正後(無劃線本)(2)
更正前(B1)	更正後(劃線部分)(B2)	
<p>…當揮發性有機溶劑之揮發氣體經由呈現開啟狀態的排放控制閥而透過排放管進入反應器後，…。</p>	<p>…當揮發性有機溶劑之揮發氣體經由呈現開啟狀態的<u>排放進氣</u>控制閥而透過<u>排放進氣</u>管進入反應器後，…。第1項所述的…。</p>	<p>…當揮發性有機溶劑之揮發氣體經由呈現開啟狀態的進氣控制閥而透過進氣管進入反應器後，…。</p>
說明	檢送書件：更正後說明書之無劃線本(2)。	

6、其他事由之更正申請專利範圍

更正內容		更正後(無劃線本)(2)
更正前(B1)	更正後(劃線部分)(B2)	
<p>1.。</p> <p>2.。</p> <p>3.第二層亦可由若干其他防水及非抗紫外線物質製成，例如二氧化鉻(CrO₂)、矽氧烷、含氟聚合物如鐵氟龍AF等。</p> <p>4. 依據申請專利範圍第1項所述的含銅廢棄物處理裝置，其中，該微波加熱裝置(1)係可利用300W至1,500W的微波功率及915MHZ的頻率，對反應器(10)加熱。</p> <p>5. 依據申請專利範圍</p>	<p>1.。</p> <p>2.。</p> <p>3.第二層亦可由若干其他防水及非抗紫外線物質製成，例如二氧化鉻(CrO₂)、矽氧烷、含氟聚合物如鐵氟龍AF等。</p> <p>4. 依據申請專利範圍第1項所述的含銅廢棄物處理裝置，其中，該微波加熱裝置(1)係可利<u>用300</u>450W至1,500 W的微波功率及915MHZ的頻率，對反應器(10)加熱。</p> <p>5. (刪除) 依據申請專</p>	<p>1.。</p> <p>2.。</p> <p>3.第二層亦可由若干其他防水及非抗紫外線物質製成，例如二氧化鉻(CrO₂)、矽氧烷、含氟聚合物如鐵氟龍AF等。</p> <p>4. 依據申請專利範圍第1項所述的含銅廢棄物處理裝置，其中，該微波加熱裝置(1)係可利用450W至1,500W的微波功率及915MHZ的頻率，對反應器(10)加熱。</p> <p>5. (刪除) 依據申請專</p>

<p>第1項所述的含銅廢棄物處理裝置，其中，該介質載體係為四氧化三鐵(Fe₃O₄)。</p> <p>6.。</p> <p>7. (刪除).....。</p> <p>8. (刪除).....。</p> <p>9. (刪除).....。</p> <p>10.。</p> <p>11.。</p> <p>12. 依據申請專利範圍第1項所述的...</p>	<p>利範圍第1項所述的含銅廢棄物處理裝置，其中，該介質載體係為四氧化三鐵(Fe₃O₄)。</p> <p>6.。</p> <p>7. (刪除).....。</p> <p>8. (刪除).....。</p> <p>9. (刪除).....。</p> <p>10.。</p> <p>11.。</p> <p>12. 依據申請專利範圍第1項所述的...</p>	<p>利範圍第1項所述的含銅廢棄物處理裝置，其中，該介質載體係為四氧化三鐵(Fe₃O₄)。</p> <p>6.。</p> <p>7. (刪除).....。</p> <p>8. (刪除).....。</p> <p>9. (刪除).....。</p> <p>10.。</p> <p>11.。</p> <p>12. 依據申請專利範圍第1項所述的...</p>
<p>說明</p>	<p>檢送書件：更正後申請專利範圍之無劃線本(2)。</p>	